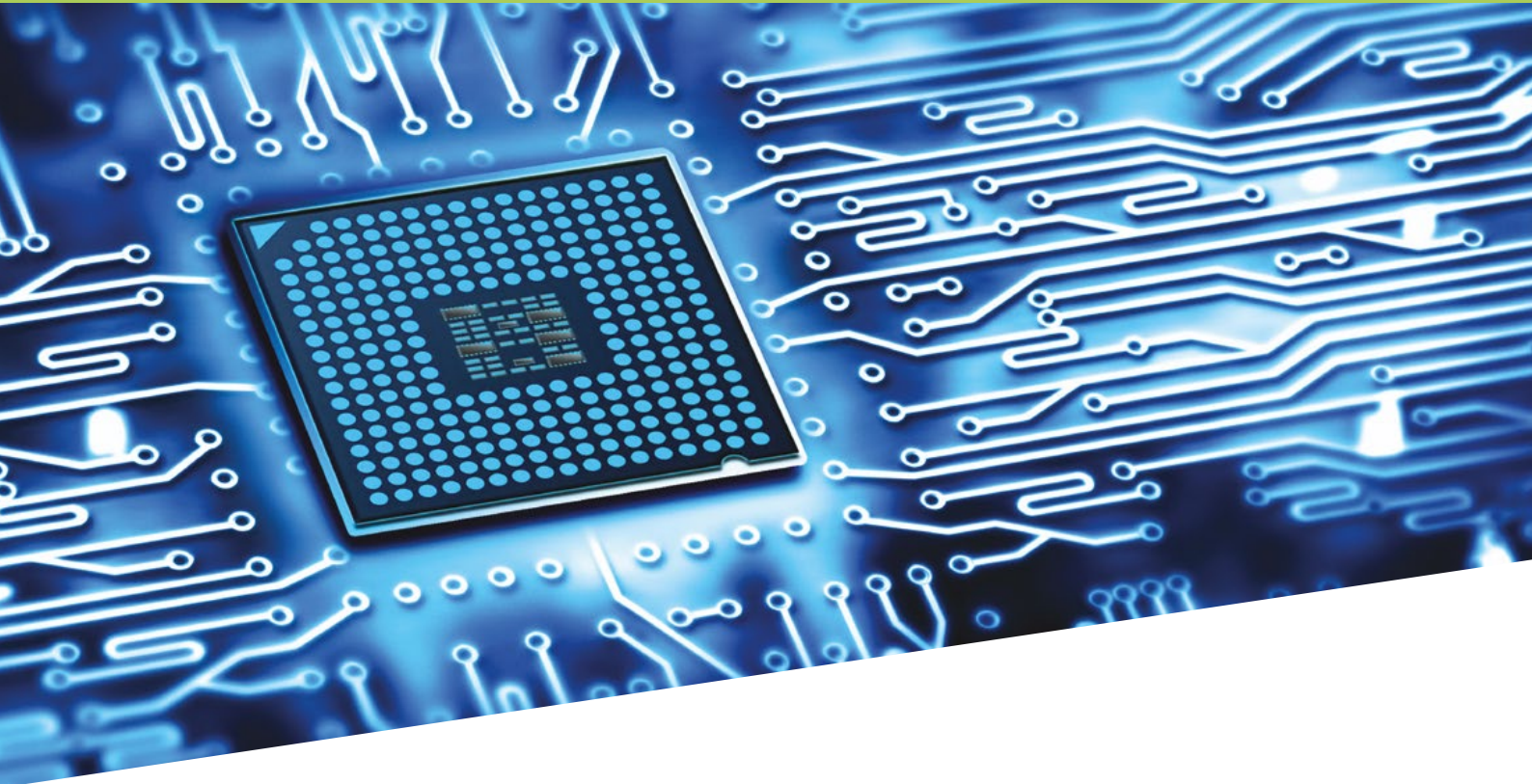


Zuverlässige Produkte zur Optimierung Ihrer Produktionsrenditen

Lösungen für Fluid Control und Pneumatik für die Halbleiterindustrie

LÖSUNG



Sicherstellen der Leistung und Zuverlässigkeit von Chips in Reinraumumgebungen

Die Komponenten und Systeme für Fluid Control und Pneumatik von Emerson sorgen für hohe Prozessreinheit und -präzision mit minimaler Kontamination der Medien in Reinräumen – zur Steigerung Ihres Durchsatzes und Optimierung Ihrer Produktionsrenditen.

- Die Produkte für Fluid Control und Pneumatik von Emerson bieten hohe Leistung und Zuverlässigkeit zur Steigerung der allgemeinen Zuverlässigkeit des Chip-Herstellungsprozesses.
- Die Produkte bieten selbst bei Vorhandensein von Spezialgasen eine überlegene Leistung, was Ihren Wartungsbedarf reduziert und Produktionsausfallzeiten minimiert.
- Ausgestattet mit IIoT-Funktionen ermöglichen diese Produkte eine Temperatur-, Durchfluss-, Druck- und Positionsregelung mit höherer Präzision und Energieeffizienz.



CONSIDER IT SOLVED™

Produktauswahl



AVENTICS™ Lösungen für Pneumatikregelung und Ventilblöcke

- Konstruiert für IIoT-Anwendungen
- Ideal für verschiedene Anwendungen – z. B. kompakte Handlingsysteme
- Bieten durchgängige Kommunikation bis zum Ventil und integrierten Webserver



ASCO™ und AVENTICS™ Proportionalventile

- Regulieren den variablen Durchfluss von Luft und Gas
- Sorgen für reaktionsschnelle, präzise Durchflussregelung, die Änderungen an der Steuerkette kompensiert
- Bieten eine optimale Druckregelung in vielen Maschinen und Prozessen weltweit
- Mit geringem Platzbedarf und großer Auswahl an Anschlussmöglichkeiten



ASCO™ Ventile für Tieftemperatur

- Entwickelt für hochleistungsfähige fluorierte Flüssigkeiten und unterstützt einen breiten Temperaturbereich
- Geeignet für den Einsatz in Kühlgeräten und Temperaturregelgeräten



ASCO™ Ventile für allgemeine Anwendungen

- Unterstützen verschiedene Fördermedien
- Robust und zuverlässig, mit Zwei-Wege-Magnetventiltechnologie
- Können schnell entsprechend den Anwendungsanforderungen dimensioniert werden



TESCOM™ Lösungen für die Druckregelung

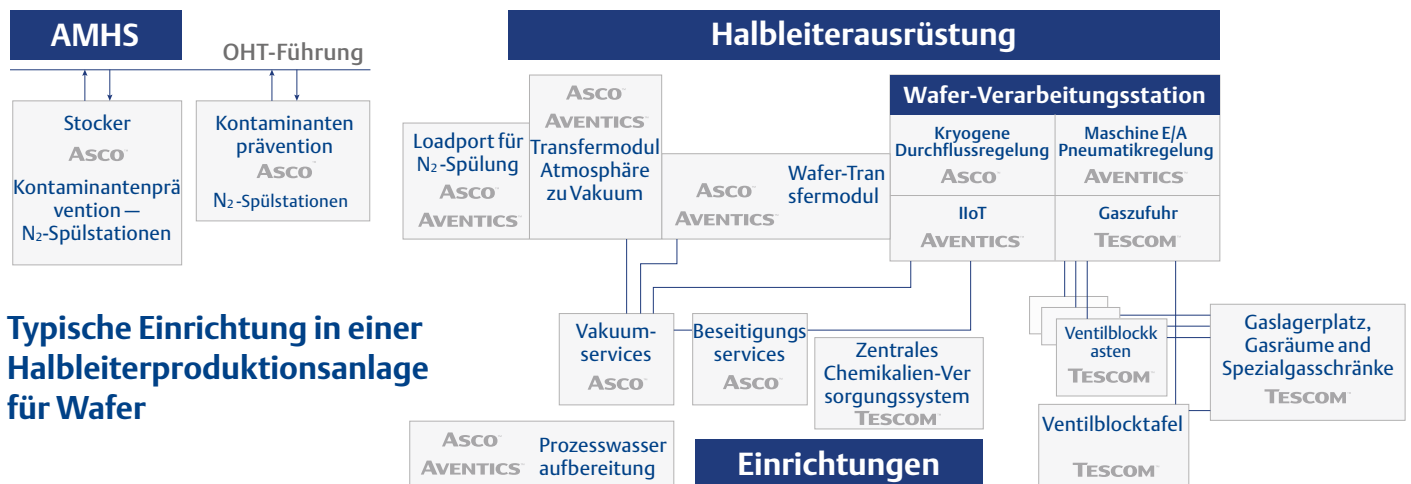
- Aufrechterhaltung und Regelung des Drucks mit Genauigkeit, Präzision und Stabilität über viele Durchflüsse hinweg
- Integrieren hochreine Konstruktionen, die Verunreinigungen sowie Wafer- und Chipausfälle während des Herstellungsprozesses verhindern



TESCOM™ Wechsel- und Elektropneumatische Steuergeräte

- Mikroprozessor basierend auf geregelter PID-Regelung
- Vollständige Automatisierung aller TESCOM Regler
- Bietet 0,1 % Genauigkeit mit 25 ms Reaktionszeit, Datenerfassung und Fernsteuerungsfunktionen
- Das Wechselsystem sorgt für die kontinuierliche Zufuhr von Prozessgas

Lösungsangebote von Emerson



Typische Einrichtung in einer Halbleiterproduktionsanlage für Wafer

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.Emerson.com/Halbleiter